PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-040858

(43)Date of publication of application: 13.02.1998

(51)Int.CI.

H01J 49/26

H01J 49/10

(21)Application number: 08-215063

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

26.07.1996

(72)Inventor: YAMAGUCHI MINORU

(54) LASER DESORPSION AND IONIZING MASS ANALYZER

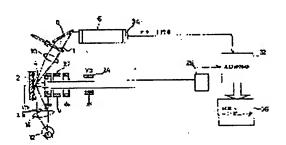
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To promote ionization with

laser beam irradiation.

SOLUTION: Prior to ionizing with laser beam irradiation, light from a lamp 12 is converged by a lens 14 and modulated by a filter 15 to be irradiated to an analyzed object 4. Laser beam is modulated by a filter 11 and converged by a lens 10 to be irradiated to the analyzed object for ionization. Resulting sample ions are drawn out with voltage Vo applied to a sample slide 2 and ground potential on the analyzed object side of an ion lens 22. The drawn-out ions fly in parallell with voltage VL applied to an ion lens at the next stage for analysis.

· Andrew



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

26.08.2002

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-40858

(43)公開日 平成10年(1998) 2月13日

(51) Int.Cl.6

證別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO1J 49/26 49/10 H01J 49/26

49/10

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 3 頁)

(21)出願番号

特願平8-215063

(71)出願人 000001993

株式会社島津製作所

(22)出願日

平成8年(1996)7月26日

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

(72) 発明者 山口 実

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

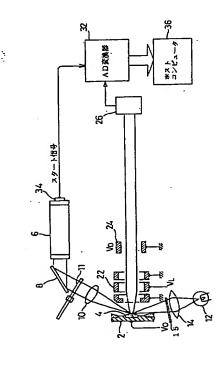
株式会社島津製作所三条工場内

(74)代理人 弁理士 野口 繁雄

(54) 【発明の名称】 レーザー脱離イオン化質量分析装置

(57)【要約】

【課題】 レーザー光照射によるイオン化を促進する。 【解決手段】 レーザー光照射によるイオン化の前に、 ランプ12からの光をレンズ14で集光しフィルター1 5で調光して分析対象物4に照射しておく。レーザー光 はフィルター11で調光され、レンズ10で集光されて 分析対象物4に照射され、イオン化が行なわれる。発生 したサンプルイオンはサンプルスライド2 に印加された 電圧Voとイオンレンズ22の分析対象物側のグランド 電位とによって引き出され、その引き出されたイオンは 次段のイオンレンズに印加された電圧VLによって平行 飛行をし、分析される。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 サンブルのみ又はサンブルとマトリック スとの混合物が分析対象物として設置されるイオン化 室、その分析対象物にレーザー光を照射してサンプルを イオン化するレーザー照射光学系、及びイオン化された サンプルイオンを引き出し質量数に応じて分離検出する 質量分析部を備えたレーザー脱離イオン化質量分析装置 において、

分析対象物がサンプルのみの場合はサンプルにより吸収 され、分析対象物がサンプルとマトリックスとの混合物 10 の場合にはマトリックス又はサンプルにより吸収される 波長域の光を分析対象物に照射する補助光照射光学系を さらに備えたことを特徴とするレーザー脱離イオン化質 量分析装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明はサンブルのみ又はサ ンプルとマトリックスとの混合物を分析対象物としてそ れにレーザー光を照射し、サンプルをイオン化させるレ ーザー脱離イオン化質量分析装置に関するものである。 [0002]

【従来の技術】レーザー脱離イオン化質量分析装置は、 サンプルのみ又はサンプルとマトリックスとの混合物が 分析対象物として設置されるイオン化室、その分析対象 物にレーザー光を照射してサンプルをイオン化するレー ザー照射光学系、及びイオン化されたサンプルイオンを 引き出し質量数に応じて分離検出する質量分析部を備え ている。レーザー脱離イオン化質量分析装置では、分析 対象物に窒素ガスレーザー(波長337nm)、Nd-YAGレーザー (波長266nm又は355nm)、炭 30 酸ガスレーザー (波長1060nm、2.94μm) な どのレーザー光を照射してサンプルをイオン化し、その イオン化されたサンプルを質量分析部に導いて分析す る。この分析方法は、レーザー光を光学レンズにより直 径数 μ m まで集光できることから、微小部分の分析が可 能なものとして注目されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】イオン化のためのレー ザー光は波長が固定されているため、サンプル又はマト 分なイオン化ができないために感度が低下することが起 こりうる。本発明はレーザー光照射によるイオン化を促 進することを目的とするものである。

[0.004]

【課題を解決するための手段】本発明では、分析対象物 がサンプルのみの場合はサンプルにより吸収され、分析 対象物がサンプルとマトリックスとの混合物の場合には マトリックス又はサンプルにより吸収される波長域の光 を分析対象物に照射する補助光照射光学系をさらに備え ている。

【0005】分析対象物がサンプルのみの場合は、サン ブル自身がレーザー光を吸収することによりレーザー光 から直接エネルギーを得てイオン化する。一方、マトリ ックスを用いる場合は、マトリックスがレーザー光を吸 収して熱エネルギーに変換し、マトリックスの一部が急 速に加熱されてサンブルとともに気化する。この場合サ ンプル分子が中性のままで脱離しても、同時に帰化され たプロトンや陽イオン (不純物として存在)、又はマト リックスイオンがサンプル分子に付加すればサンプルイ オンとなる。レーザー光は1ナノ秒程度のパルスレーザ 一光として照射するのが好ましい。

【0006】マトリックスを用いる場合のサンプル調製 は、サンプル溶液とマトリックス溶液をモル比で1:1 00~1:10000で混合した後、乾燥させ、両者が ミクロンレベルで均一に混合された状態を作る。その結 果、サンブルの微細な結晶を多量のマトリックス結晶が 取り囲んだ結晶状態又はアモルファス状態となってい る。一般にはこの分析対象物には不純物として、又は予 め添加された陽イオンや陰イオンが含まれている。

[0007] レーザー脱離イオン化質量分析に用いられ る質量分析部としては、飛行時間型質量分析装置(TO FMS)が用いられるが、フーリエ変換型イオンサイク ルトロン共鳴質量分析計(FTMS)、磁場と電場を用 いてイオンを選別して検出器に導く二重収束型質量分析 計(ダブルフォーカスMS)、三次元四重極型イオント ラップ質量分析計等も使用することができる。

【0008】レーザー脱離イオン化を飛行時間型質量分 析装置と組み合わせれば分子量では免疫グロブリンM (平均分子量900kDa)まで検出でき、検出限界も amo1レベルに達していると言われている。また、イオン 化が可能な化合物はペプチド、タンパク質、多糖類、複 合脂質、核酸関連物質等の生体関連物質一般、合成ポリ マー、オリゴマー、金属配位化合物や無機化合物まで広 範囲に及んでいる。マトリックスを用いる場合、そのマ トリックスとしては種々のものが使用されており、例え ば「分析」No.4、253~261 (1996) に記 截されているものを使用することができる。

[0009]

【実施例】図1に本発明を飛行時間型質量分析装置に適 リックスによっては最適な波長を選ぶことができず、十 40 応した一実施例を示す。イオン化室にはサンプルスライ ド2に乗せられた分析対象物4が設置される。分析対象 物4はこの場合、サンブルとマトリックスとの混合物と する。サンプルをイオン化するための窒素レーザー(波 長337nm) 6からのレーザービームを分析対象物4 に集光して照射するために、ミラー8、そのミラー8で 折り曲げられたレーザー光を集光する光学レンズ10及 びレーザー光の不要な髙調波等を除去するための光学フ ィルター11が配置されている。

> 【0010】レーザー光を照射してイオン化する際に分 50 析対象物を加熱しておくために、補助光照射光学系とし

3

てランブ光源12、及びその光源12からの光を分析対象物4に集光して照射する光学レンズ14、及び被長を選択するフィルタ15などが配置されている。ランプ12は可視域から紫外域の波長を発するものが好ましく、例えばD,ランプ、水銀ランプ、キセノンランプ等を用いることができる。

【0011】イオン化されたサンプルイオンを分析するための質量分析部として、飛行時間型質量分析計が設けられている。その質量分析計は、分析対象物4に接近してイオンを引き出すためのイオンレンズ22、そのイオンレンズ22で引き出されたイオンを検出器の方向に導いたり、検出器の方向から外れた方向に導くための偏向板24、その偏向板24を通過したイオンが入射して検出される検出器26を備えている。

【0012】検出器26からのイオン検出信号はAD変換器32に導かれる。飛行時間型質量分析装置では飛行時間を測定するための時間の原点(ゼロ点)を定めるために、窒素レーザー6にはフォトダイオード34が設けられ、そのフォトダイオード34の検出信号がスタート信号としてAD変換器32に導かれる。AD変換器32ではスタート信号を時間の原点として検出器26の信号をデジタル信号に変換する。36はAD変換器32でデジタル信号に変換された検出器信号を入力してデータ処理をしたり、この分析装置全体の動作を制御するホストコンピューターである。

【0013】次に、この実施例の動作について説明する。レーザー光照射によるイオン化の前に、ランプ12からの光をレンズ14で集光し、フィルタ15で調光して分析対象物4に照射しておく。レーザー光はフィルター11で調光され、レンズ10で集光されて分析対象物 304に照射され、イオン化が行なわれる。発生したサンプルイオンはサンプルスライド2に印加された電圧Voとイオンレンズ22の分析対象物側のグランド電位とによって引き出され、その引き出されたイオンは次段のイオ*

*ンレンズに印加された電圧VLによって平行飛行をする。偏向板24の電位VDがグランド電位であるときは、イオンが直線飛行して検出器26に到達し検出される。偏向板24に電位VDを印加すれば、イオンは曲げられて検出器26には到達しなくなる。

【0014】イオンは検出器26で検出されて増幅された後、レーザー発振時点を飛行時間の原点としてAD変換器32によってデジタル信号に変換され、ホストコンピューター36に導かれて分析がなされる。レーザー610は分析部20の真空系の外部に設置し、真空系の光導入窓を通して導入する。補助光照射光学系のランプ12とレンズ14は、分析部20の真空系内に設けることもできるし、真空系の外部に設け、真空系の光導入窓を通して分析対象物を照射するようにしてもよい。

[0015]

[発明の効果]本発明では補助光照射光学系を備えてレーザー光によるイオン化の際に光を分析対象物に照射しておくようにしたので、レーザー光によるイオン化が促進され、高感度に分析を行なうことができるようにな 20 る。

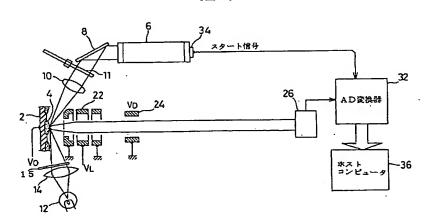
【図面の簡単な説明】

【図1】一実施例を示す概略構成図である。

【符号の説明】

- 2 サンプルスライド
- 4 分析対象物
- 6 窒素レーザー
- 10 レンズ
- 11 光学フィルター
- 12 ランプ光源
- 14 レンズ
- 22 イオンレンズ
- 2.4 偏向板
- 26 検出器

[図1]



THIS PAGE BLANK (USPTO)